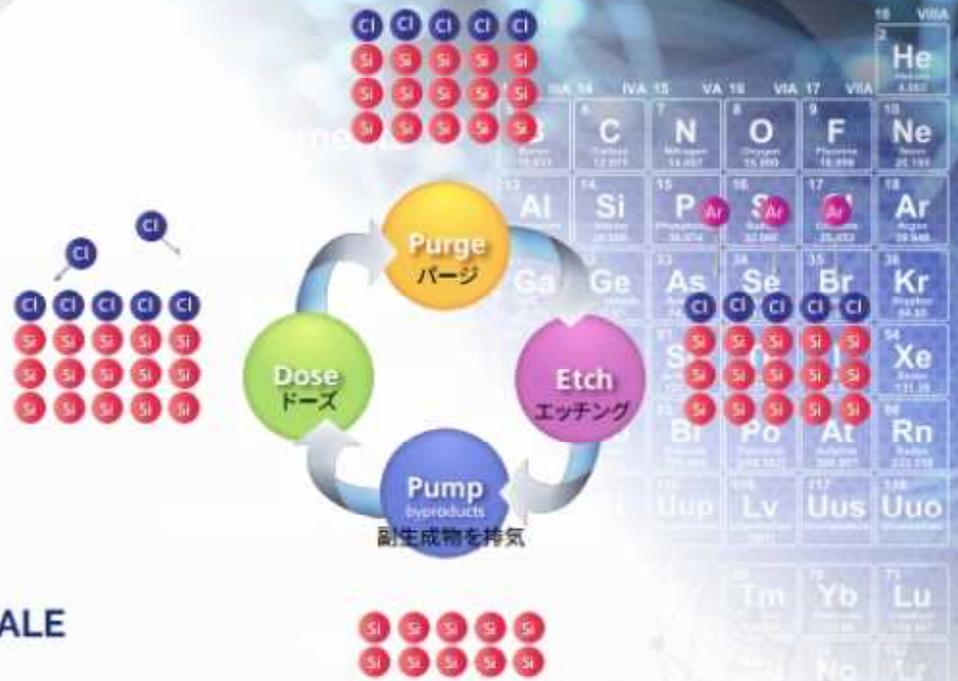


Atomic Layer Etch (ALE)

A cyclical etch process サイクルエッチングプロセス

Benefits of ALE ALEの利点

- Ultra low damage
低ダメージ
- Ultra high selectivity
高選択比
- Ultra accurate
高精度なエッチング
深さ制御



Plasma Pro 100 Cobra ALE Configuration の構成

- Fast recipe control down to 10ms
10msの高速レシピ制御
- ALD-style gas dose delivery using "ALD valves" with 10ms open-close response
10msの開閉反応のALD式ガス供給システムを使用
- Ultra low power operation
低パワー出力
- Ability to etch in ALE or normal etch mode
ALEもしくは通常のエッチングモードによる
選択機能

